# CL によるプラズモニクス材料の研究

# Characterization of Plasmonic Materials by CL

# 山本 直紀,本田 昌寛,渡辺 裕朗

Naoki Yamamoto, Masahiro Honda and Hiroaki Watanabe

# 東工大院理工

要旨金属表面を伝播する表面プラズモンポラリトン (SPP) は表面に局在する電磁場を伴う電荷密度波であり、光の回折限界を超えて波長以下の狭い領域に閉じ込めることができ、入射光の電場を増強する性質をもつことから、その性質を利用したプラズモニクスと呼ばれる技術分野が急速に発展している. SPP は高速電子の入射により励起できるので、走査型透過電子顕微鏡 (STEM)の細く絞られた電子ビームを用いることでナノメーターオーダーの高い空間分解能の測定が可能となる. 励起された SPP は表面ナノ構造により光に変換される. STEM と組み合わせたカソードルミネッセンス (CL)検出システムは、放射された光のエネルギースペクトル、偏光特性、放射角依存性を調べることができる.本稿では、STEM-CL 法を用いてプラズモニック結晶やプラズモニック Cavity における SPP の分散関係やバンドギャップ、定在波の性質を調べた結果を紹介する.

キーワード:カソードルミネッセンス、表面プラズモン、プラズモニック結晶、走査型透過電子顕微鏡

#### 1. はじめに

物質中の電子の集団振動を量子化した振動モードをプラズ モンと呼び、とくに表面に局在した表面誘導電荷の振動を表 面プラズモン (Surface Plasmon: SP) と呼ぶ. 表面プラズモ ンには金属微粒子などに局在した局在表面プラズモン(Localized Surface Plasmon: LSP) と金属表面や金属一誘電体界 面を伝播する表面プラズモンポラリトン(Surface Plasmon Polariton: SPP) とがあり、どちらも金属表面近傍に局在し た電磁場を伴っている.表面プラズモンは 1954 年に Richie<sup>1)</sup> により理論的に存在が予想され、光吸収や電子エネルギー損 失分光法 (EELS) などにより実験的に証明されて以後多くの 研究が行われた<sup>2)</sup>. 平面状の表面を伝播する SPP は光と相互 変換できないが,金属薄膜を付着させたプリズムや金属の回 折格子を用いることで光との相互変換が可能となる. 1998年 に Ebessen ら<sup>3)</sup>が、光の波長以下のサイズの孔を2次元配列 させた金属薄膜で光の異常透過現象を発見したことがブレー クスルーとなり、表面プラズモンの研究が一躍注目を集める こととなった. SP の特徴として、電磁場の表面局在性と増 強効果が挙げられる. 表面局在領域の強い電磁場を利用して, 金属微粒子や金属ナノ構造を用いた有機分子に対する高感度 バイオセンサーが開発され実用化されている<sup>4)</sup>. また, SP は 光の回折限界を超えてナノメーターオーダーの領域に閉じ込 められることから光集積回路における導波路としての応用が

〒152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1 TEL: 03-5734-2481; FAX: 03-5734-2232 E-mail: nyamamot@phys.titech.ac.jp 2014年2月5日受付 考えられている. SPの電場増強効果の利用として,金属ナノ 構造を使った LED や太陽電池の量子効率向上への応用が考 えられている. このように電子回路における集積性と光の高 速応答性を併せ持つ表面プラズモンの性質を利用する技術分 野はプラズモニクスと呼ばれ最近急速に発展している<sup>5~8)</sup>.

SPP は光と相互変換することができ,その変換には従来から光の波長と同程度またはそれ以下の周期を持つ金属表面構造が用いられてきた<sup>2)</sup>. このような金属表面上では SPP の分散関係は結晶中の電子状態と類似して,ブリルアンゾーンの折りたたみにより光の分散線の内側に分散線が入り,バンドギャップが開いたバンド構造を形成する.金属表面周期構造では,バンドギャップ内のエネルギーをもつ SPP は周期構造内を伝播できない.一方,バンド端のエネルギーでは SPP の状態密度が大きくなることから光変換効率を向上させることができる. これらの性質を利用して, SPP に対するミラーや導波路, Cavity,バイオセンサーが考えられている. 周期構造をもつ金属表面はプラズモニック結晶と呼ばれ, SPP を応用するプラズモニクス分野で重要な素材となっている.

プラズモニック結晶を使った SPP. 光変換や SPP 光学素子 の設計には、バンドギャップおよびバンド端エネルギーを制 御し、SPP モードの詳細な性質を知る必要がある.しかし、 光学的な手法では高い空間分解能での観察が困難であり、十 分な情報が得られていない.SPP は電子線によって励起する ことができ、従来から金属表面の周期構造における SPP の 分散関係が電子線を用いた実験で調べられている<sup>9</sup>.最近で は、CL 装置と組み合わせた SEM や STEM を用いて金属薄 膜の穴周囲の LSP 発光、SPP の伝播、光の波長以下の周期 構造をもつ金属表面(プラズモニック結晶)上の SPP の分



図1 (a)高分解能走査型透過電子顕微鏡 (JEM-2100F)と組み合わせた CL 検出システム, (b) STEM-CL 検出システムの模式図.

散関係の測定が行われている<sup>10,11)</sup>.本稿では,特に1次元お よび2次元のプラズモニック結晶における SPP の分散関係 とバンドギャップが表面形状やサイズによりどのように変化 するか調べた結果を紹介する.

# 2. STEM-CL 法の応用

#### 2.1 装置

表面プラズモンは電子顕微鏡内で電子線によって励起する ことができ、試料から放出される光はカソードルミネッセン ス(CL)検出装置によって検出できる.本研究室ではCL検 出システムを組み込んだ走査型透過電子顕微鏡 (STEM) を 用いて、金属微粒子の LSP と金属表面のナノ構造における SPP の性質を調べている. STEM は2台(IEM-2000FX と JEM-2100F)使用しており、CL検出システムは同様な構成 である. CL 測定では、試料によっては十分な発光強度が得 られないため電子ビーム電流を通常1nAのオーダーにして おり, STEM のプローブ径は通常の STEM 観察に比べ広がっ てしまう. 古い方の STEM ではビーム電流 1 nA でビーム径 は10 nm 程度であったが、もう一方の STEM (JEM-2100F)は、 ZrO/W 電界放出型電子銃(Field Emission Gun: FEG)と照射 系に組み込んだ球面収差補正装置を搭載しており、ワイド ギャップポールピース(ギャップ幅9mm)を用いても電子 プローブ径を1nm以下に収束できる(図1(a)). ここでは 後者の装置について構成や機能を説明する.この装置は二次 電子像(Secondary Electron Image: SEI),および反射電子像 (Backscattered Electron Image: BEI) 検出器を備えており、薄 膜試料以外にバルク試料表面の高分解能観察が可能である. 電子線の加速電圧は80kVおよび200kVに設定でき,照射 損傷が大きな試料に対しては 80 kV で測定を行っている.

CL 検出システムでは、集光用に放物面ミラーを用い、レ ンズで検出系に直接光を導入する光学系を採用した. 放物面 ミラーは、アルミニウム製で高さ8mm, 焦点距離1.5mm, 試料に対し電子線の入射側と反対側の両方の空間に放射され る光を集光できるように設計されている. ミラーと検出器と の間に偏光素子および放射角分解用 X-Y ステージを含む光学 系を設置した. 偏光素子の後方にレンズを置き, ミラーの像 を X-Y ステージ位置に作る. X-Y ステージにピンホールのあ るマスクを設置し,放射された光の偏光方向と放射角を選択 したスペクトル分光が可能となる.後述するように,測定し た角度分解スペクトル像から分散関係を示すパターンに変換 することが可能である.

# 2.2 測定法

角度分解した CL スペクトル測定の試料と集光ミラーの配置を図2(a)に示す. 放物面ミラーには試料の上方に電子ビームの通る径 0.6 mm の穴が開いており, 試料のビーム照射位置が放物面ミラーの焦点位置に一致するように試料とミラーの相対位置を調整する.

試料を図2(a)のように周期構造の配列する方向を放物面の軸(x軸)に垂直な方向(y軸)に設定する. ピンホールを垂直方向に動かしながらスペクトルを測定しピンホール位



図2 角度分解スペクトル測定の配置図.(a) 試料表面を水平 にした場合,(b) 試料表面を傾斜した場合.

置を横軸に2次元的に並べると、図2(a)右図の赤線で示す ように $\theta = 0^\circ$ から 90° までの放射角変化に対応する分散パ ターンが得られる.これを角度分解スペクトル(ARS)パター ンと呼ぶ. ピンホール位置を角度に変換し、さらにx方向の 波数に変換すると Γ-X 方向の分散関係を表すパターンに変 換できる<sup>12,13)</sup>.しかし、試料を水平に置くと表面垂直方向に はミラーの穴がくるので、逆格子空間の原点(Γ点)に相当 する方向のスペクトルが測定できない. Γ点付近の ARS パ ターンを測定するため、 試料表面垂直方向を電子ビームの入 射方向からx軸方向に傾ける. 試料表面垂直方向を基準軸と した極角 $\theta$ と方位角 $\varphi$ は図2(b)の右図ようになる. 図の赤 線で示すように、ピンホールを水平方向に動かしたとき、ピ ンホール位置に対応する放射角は, θが小さい範囲では近似 的に $\varphi$ 一定 ( $\varphi$ =90°) で $\theta$ のみが変化すると見なせる. こ のようにして、水平方向にマスクを移動させて測定したスペ クトルから、Γ点を含む逆空間のΓ-X方向の分散パターンを 得ることができる. ピンホール位置を固定し, 電子ビームを 走査しながら放射スペクトルを記録した結果を電子ビーム位 置に対し並べて表示した2次元像をビーム走査スペクトル (BSS) 像と呼ぶ. ピンホール位置をΓ点に対応する位置に 設定すると、BSS 像にはΓ点における SPP モードの定在波 パターンが現れる. ピンホール位置を固定し、電子ビームで 2次元領域を走査しながら放射スペクトルを記録すれば、 2次元定在波パターンを表すフォトンマップが得られる.

#### 3. 表面プラズモンポラリトンの基礎的性質

#### 3.1 分散関係

表面プラズモンポラリトン (SPP) とは金属と誘電媒質の 界面に局在した表面電荷を伴う電磁波の集団振動モードで, 光と表面プラズモンとが結合した表面伝播モード (TM モー ド)である. SPP の分散関係は

$$k_{p} = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{\varepsilon_{0} \varepsilon(\omega)}{\varepsilon(\omega) + \varepsilon_{0}}} \tag{1}$$

と表される<sup>2,0,11)</sup>. ここで、 $\varepsilon_0$  および  $\varepsilon$  はそれぞれ真空および 金属の比誘電率、 $k_p$ はSPPの波数である. 銀表面のSPPの分 散線を例として示すと、図3(a)のように波数が小さいとこ ろでは光の分散線に漸近し、波数が大きくなると  $\varepsilon(\omega_s) = -2$ から決まる一定値(エネルギーで $\hbar\omega_s = 3.67 \ eV$ )に近づく. 平面上を伝播する SPP は波数の整合条件を満たさないため 光と相互変換することができない. しかし、表面上の凹凸や 周期構造を介して光に変わることができる.

1次元周期構造の SPP の分散関係は,平面上を伝播する場合の分散曲線をブリルアンゾーン境界で折り畳んだ曲線の重ね合わせによって構成される.ゾーン境界で分散線が交差したところではエネルギーの異なる2つの定在波が生じ,バンドギャップが開く(図3(b)).赤線で示す光の分散線(Lightline)の内側の領域の SPP モードは,空間に放射される光と 波数の整合条件を満たして結合できるので CL 法により検出



図3 銀表面の SPP の分散関係. (a) 平坦な表面, (b) 1 次元 プラズモニック結晶.



図4 SPP から光への変換.

可能であり,前述した角度分解測定により分散関係を求める ことができる.周期構造により SPP が光に変換されるとき の条件について次節で述べる.

#### 3.2 周期構造による SPP- 光変換

周期構造中を SPP が伝播するとき表面構造により SPP は 光に変換される.図4において原点Oにある散乱体で放出 された光と,原点からr離れた位置Rにある散乱体から放 出された光の間の位相差は,

 $\omega \Delta t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_{p} \cdot \mathbf{r} - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = (\mathbf{k}_{p} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}$ 

と表わされる. ここで、 $\Delta t$ は SPP の波面が O から R に伝 播するまでの時間で、 $\omega$ は SPP と光に共通の振動数である.  $k_p$ および k は、それぞれ SPP および放射される光の波数ベ クトルである. rをn 番目の格子点の格子ベクトル  $R_n$  と格 子内部のi番目の散乱体の位置ベクトル  $r_i$ で表し、1つの散 乱体により SPP が光に変換される振幅を $f(k_p,k)$  とおくと、 全ての散乱体により変換された光放射の振幅は

$$\psi(\mathbf{k}_{p},\mathbf{k}) = \psi_{0} \sum_{n} f(\mathbf{k}_{p},\mathbf{k}) \exp[i(\mathbf{k}_{p}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_{ni}]$$

$$= \psi_{0} \left[ \sum_{i} f(\mathbf{k}_{p},\mathbf{k}) \exp(i(\mathbf{k}_{p}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_{i}) \right]$$

$$\cdot \left[ \sum_{n} \exp(i(\mathbf{k}_{p}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}_{n}) \right]$$

$$= \psi_{0} F(\mathbf{k}_{p},\mathbf{k}) \cdot \left[ \sum_{n} \exp(i(\mathbf{k}_{p}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}_{n}) \right]$$
(2)

と表される. ここで、 $\psi_0$ は、入射 SPP の振幅である.  $R_n \ge r_i$ は面内のベクトルであるから $k_{//} \ge k$ の面内成分として、 $k \cdot R_n = k_{//} \cdot R_n$ が成り立つ. したがって、放射される光の強度は

$$I_{ph} = \left| \psi(\boldsymbol{k}_{p}, \boldsymbol{k}) \right|^{2}$$
$$= \left| \psi_{0} \right|^{2} \cdot \left| F(\boldsymbol{k}_{p}, \boldsymbol{k}) \right|^{2} \cdot L(\boldsymbol{k}_{p} - \boldsymbol{k}_{\prime\prime})$$
(3)

と表される. F およびLは、回折理論で現れる構造因子とラウエ関数に相当する.以上から、SPP が表面周期構造上を伝播するとき放射される光が干渉する条件は、

$$\boldsymbol{k}_p - \boldsymbol{k}_{\prime\prime} = \boldsymbol{G} \tag{4a}$$

$$E_{SPP} = E_{ph} \tag{4b}$$

となることが導かれる.ここで、Gは表面周期構造の逆格子 ベクトルである.

#### 4. 1次元プラズモニック結晶

#### 4.1 SPP 定在波とバンドギャップ

1次元周期構造の基本並進ベクトルを*a*とすると、対応する基本逆格子ベクトル*a*\*を使い逆格子ベクトルは*G*=n*a*\*で表わされる.ここで、nは整数である.表面垂直方向の光放射では $k_{//}=0$ (Γ点)であり、SPP-光変換の条件式(4a)は、 $k_p = G$ の波数ベクトルをもつ平面波 SPP に対して成り立つ. 1次元のプラズモニック結晶で分散線が交差する位置(ブリルアンゾーン境界)の波数ベクトルをもつ SPP 波があると、周期構造により Bragg 反射を起こし、入射波の波数ベクトルとの間に $k_p = G$ を満たす波数ベクトル $k_p$ をもつ反射波が同時に発生し、それらの合成として定在波が形成される. SPP 波は一般にブロッホ関数により

$$\psi_{k}^{n}(\boldsymbol{r}) = \exp i \left(\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}\right) u(\boldsymbol{r}) = \sum_{G} C_{G}^{n} \exp i \left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}\right) \cdot \boldsymbol{r}$$
(5)

と表される.  $\Gamma$ 点 (k=0) における最低次の定在波は, エネ ルギーが同じで $G=2\pi/P$ の大きさの波数ベクトル $k_p=\pm a^*$ をもつ反対方向に伝播する2つの平面波で主に構成される. すなわち,  $\Gamma$ 点における最低次のエネルギー状態のSPPは, 高次項を無視すると主にこの2つの平面波で構成される定在 波として近似的に表される.

$$\psi(\mathbf{x}) \cong C_1 \exp\left(2\pi i \frac{\mathbf{x}}{P}\right) + C_{-1} \exp\left(-2\pi i \frac{\mathbf{x}}{P}\right) \tag{6}$$

ここで、関数ψは表面電荷密度を表し、すなわち表面に垂 直な電場成分を表す.座標原点を1次元周期構造のテラスの 中心にとると、表面構造は中心を通り表面に垂直な軸の周り に2回回転対称性をもつ.2回回転対称操作C<sub>2</sub>による波動 関数の変換を

$$C_2 \psi = \kappa \psi \tag{7}$$

と書くと、 $360^{\circ}$ の回転に対し元に戻ることから $\kappa^{2}=1$ が成り 立つ. すなわち、 $C_{2}$ の固有値として $\kappa=\pm1$ が得られる. 2つの固有値に対応する固有関数は

$$\psi^{s}(x) \cong \sqrt{2} \cos\left(2\pi \frac{x}{P}\right), \quad \psi^{A}(x) \cong \sqrt{2} \sin\left(2\pi \frac{x}{P}\right)$$
(8)

となる. 添字 S と A は, それぞれテラスの中心に対して対称および反対称な定在波を表す. 2 つの定在波が形成する表面近傍に局在する電磁場のエネルギーが異なるため  $\Gamma$  点で交差する分散線にギャップが生じる. 同様にして, X 点における定在波は,  $k_{//} = \frac{a^*}{2}$ ,  $k_p = \frac{3a^*}{2}$  として,

$$\psi^{s}(x) \cong \sqrt{2} \cos\left(3\pi \frac{x}{P}\right), \quad \psi^{A}(x) \cong \sqrt{2} \sin\left(3\pi \frac{x}{P}\right)$$
(9)

と表される.

SPP バンド構造のブリルアンゾーン境界におけるバンド ギャップの大きさは、表面形状関数の対応する波数におけ るフーリエ級数に依存することが Barnes らによって示され た<sup>14)</sup>. 彼らは波数  $k_p \ge 2k_p$ の2つの正弦波成分のみをもつ 表面周期構造に対して  $\Gamma$ 点における SPP のエネルギーを解 析的に導いた.  $\Gamma$ 点のバンドギャップ上下のバンド端の角周 波数は

$$\left(\frac{\omega_{2}^{A,S}}{c}\right) = \left[\left(\frac{\omega_{0}}{c}\right)^{2} \left\{1 - \left(k_{p}h_{2}\right)^{2}\right\} \pm 2\left(k_{p}h_{2}\right) \frac{k_{p}^{2}}{\sqrt{-\varepsilon_{0}\,\varepsilon}} \left\{1 - \frac{7}{2}\left(k_{p}h_{2}\right)^{2}\right\}\right]^{\frac{1}{2}}$$
(10)

と表される. ここで、 $\epsilon_0$  および $\epsilon$ はそれぞれ真空および金属 の比誘電率、 $k_p$  は表面構造の周期を P として 2 $\pi$ /P に等しい.  $\omega_0$  は波数 2 $\pi$ /P の SPP の角周波数で、(1) 式の分散関係(図 3 (a)) から決まり、P = 600 nm の場合には  $E_0 = \hbar\omega_0 = 2.0 \ eV$  と なる.  $h_2$  は波数  $2k_p$  の正弦波成分の振幅、すなわち表面形状 関数の 2 次のフーリエ係数である. 矩形断面の表面形状関数 の n 次のフーリエ係数は次式で表される.

$$h_n = \frac{h}{n\pi} \sin\left(n\pi \frac{D}{P}\right) \tag{11}$$

(10) 式の右辺の複号は SPP 定在波の対称モード(S モード) と反対称モード(A モード)の周波数に対応しているが、 $h_2$ の符号によりその大きさが変わる.

# 4.2 1次元プラズモニック結晶の CL 法による観察

1次元プラズモニック結晶として断面が矩形をした直線状 の溝が配列した金属表面構造を用いた. 周期 P を 600 nm, 溝の間のテラスの高さを 70 nm に固定して、テラス幅 D を いろいろ変えた構造を InP 基板上に作製し、上から銀を 200 nm の厚さ蒸着して試料とした. 図 5 (a) に、D/P を変え たときの表面垂直方向(Γ点)の放射スペクトルの変化を示 す. ピークエネルギーを D/P に対してプロットした結果を 図5(b)に示す.プロットの赤点と白点は、定在波の対称モー ドと反対称モードの違いを示す. D/P が 1/4 と 3/4 付近でバ ンドギャップは最大となり、1/2付近でバンドが交差するの が見られる. 図5(b)の背景の強度分布は厳密結合波解析 (RCWA) 法によって計算した光の吸収スペクトルの D/P 依 存性を表している。 光の吸収は SPP の励起によって起こる ので、吸収スペクトルは SPP- 光変換効率を表していると言 える、電子ビームで励起された SPP がプラズモニック結晶 により光に変換されるのはその逆過程に対応する. 白い実線 と点線は、Barnes らの式((10)式)を用いて計算した対称モー ドと反対称モードのエネルギーである. 実験結果と比較する と、エネルギーの高い方のピークは SPP と同じ波数の光の エネルギーが上限となるので比較的一致しているが、低い方 のピークは(10)式の結果に比べ大きく低いエネルギーにず れている.これは矩形の形状関数が含む高次項の影響と考え られる. RCWA 法の結果に比べると少しだけ高いエネルギー にずれているのは、実際の試料形状ではエッジが丸くなり矩 形からのずれがあるのが原因と考えられる<sup>16)</sup>.

図5(c)は、D/P=3/4の構造におけるテラス高さに対する ピークエネルギーの依存性を示す.低エネルギー側の反対称 モードのエネルギーが高さの増加にほぼ比例して下がってい くのが見られる.放射強度については、実験からはテラス高



図5 (a)1次元プラズモニック結晶からの放射スペクトル, (b) ピークエネルギーの D/P 依存性 (テラス高さ 70 nm), (c) テ ラス高さ依存性 (D/P=3/4).

さが 50 nm から 100 nm の間が最大で,200 nm になるとほ ぼ消失するのが観察された.

テラス高さ 70 nm で D/P が 1/4, 1/2 および 3/4 の試料から の放射を図 2 (b) の配置で測定した ARS パターンを図 6 (a) -(c) に示す. 図の中心が  $\Gamma$  点であり, その位置の縦軸に沿っ た強度分布が図 5 (a) のスペクトルに対応する. ピンホール を  $\Gamma$  点の位置に固定して測定した BSS 像を図 6 (d)-(f) に示 す. D/P = 1/4 では高エネルギー側が反対称モード,低エネル ギー側が対称モードであり, D/P = 3/4 ではそれが逆になっ ていることが分かる. D/P = 1/2 では反対称モードのピーク が対称モードのピークを挟んで分裂しているのが見られるが (図 6 (e)), その理由については不明である.

図 7 (a) は, 周期 800 nm, D/P = 1/2 の試料の表面垂直方向 から傾いた X 点に対応する方向に放射された光を用いて測 定した BSS 像である. この像におけるコントラストが SPP 定在波の表面電荷分布を直接表しているのかを見るために, RCWA 法を用いて 2 つのバンド端エネルギーの SPP 定在波



図 6 (a)-(c) D/P = 1/4, 1/2 および 3/4 の試料からの ARS パター ンと (d)-(f) Γ点の放射による BSS 像.



図7 (a) P=800 nm, D/P=1/2の試料のX点の放射による BSS 像. (b), (c) バンド端上下のエネルギーのSPP 定在波の 電場強度分布.



図8 (a) D/P=1/4 と (b) D/P=3/4 の場合の表面形状関数の 1次と2次の周波数成分と表面電荷分布.

が作る電場の z 成分の絶対値 2 乗を計算した結果を図 7 (b) と(c) に示す. 各図の下側の黒いコントラストは1次元プラ ズモニック結晶の断面を表す. 図 7 (a) のコントラストを(b) と(c) の電場分布と比較すると両者が良く対応しており, BSS 像が SPP 定在波を可視化していると言うことができる. すなわち,電子ビームは照射位置での SPP 定在波の局所状 態密度に比例して SPP を励起し,その励起強度に対応する 大きさで光を放射すると考えられる<sup>15)</sup>. 図 7 (a) では,入射 電子は 2 つの SPP 定在波を同程度の大きさで励起するはず であるが,両者の放射強度には大きな差が生じている. 高エ ネルギー側の対称モードの放射強度は低エネルギー側の反対 称モードに比べ非常に弱い. これは, SPP 定在波と放射する 光との間の変換効率の差による.

対称モードと反対称モードの SPP 定在波が光に変換され る効率の違いを  $\Gamma$ 点の放射を例にして説明する. 図8は、(a) D/P=1/4 と (b) D/P=3/4 の場合についてプラズモニック結 晶の表面形状関数の1次と2次の周波数成分を描いている. バンドギャップは2次の成分だけに依存するが、光放射には 1次の成分が必要である. 下側に  $\Gamma$ 点の2つのモードの電荷 分布を示す. 表面垂直方向に放射される光の電場ベクトルは 表面に平行である. 表面に平行な電場成分を生じる電荷分布 は反対称モードの方であることが図から明らかであり、D/P の値にかかわらずこのモードが光と強く結合できることが分 かる. ただし、2次の周期構造における電荷分布の違いによ り、D/P=1/4 と 3/4 の場合で2つのモードのエネルギーは逆 になる(図6). すなわち、2次の周期構造の山の位置に電 荷分布のピークが一致するモードが常に低エネルギー側に現 れる.

# 5. 2次元プラズモニック結晶

## 5.1 正方格子

周期Pの正方格子をもつ2次元プラズモニック結晶の $\Gamma$ 点における最低次の定在波は $G = 2\pi/P$ の大きさの波数ベク トル $k_{p} = \pm a^{*}, \pm b^{*}$ をもつ4つの平面波で主に構成される.

解説 CLによるプラズモニクス材料の研究

すなわち, Γ点における最低次のエネルギー状態の SPP は, 高次項を無視すると主にこの4つの平面波で構成される定在 波として近似的に表される.

$$\psi_{\Gamma}^{n}(\boldsymbol{r}) = C_{1}^{n} \exp(i\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}) + C_{2}^{n} \exp(i\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{r}) + C_{3}^{n} \exp(-i\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}) + C_{4}^{n} \exp(-i\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{r})$$
(12)

表面垂直軸の周りの4回回転対称性があることから、この状態関数は90度回転操作 $C_4$ の固有関数であり、4つの固有値 とその固有関数が導かれる. 群 $C_4$ の指標表を用いて4つの モードの係数 $C_i^n$ を求めることもできる. 4つの係数が全て 1であるAモードは全対称モードで、格子点と格子の中心に 極大を持つ. Bモードは格子点の周りに2回回転対称なモー ドで、格子点と格子点の間に極大を持つ.  $E_1 \ge E_2$ モードは 格子点に対して反転対称なモードでありエネルギー的に縮退 している. 円柱の周囲の電荷分布からAとBモードは非放 射で、 $E_1 \ge E_2$ モードは強い放射を生じると予想される<sup>17)</sup>.

直径Dの円柱が正方格子状に周期配列した構造(図9 (a))で、周期Pを600 nm、高さhを100 nm にしてDを いくつか変えた試料を作製した. 図9(b)に、(12)式を 用いて SPP 定在波の表面垂直方向の電場強度の時間平均  $\left< \left| \text{Re} \left[ \psi_{\Gamma}^{n}(\mathbf{r}) \exp(-i\omega t) \right]^{2} \right>_{t}$ 計算した結果を示す.時間平均を 行えば $E_{1} \ge E_{2} = -$ ドの強度分布は同じになる. 図9(c) に



図9 正方格子2次元プラズモニック結晶のバンド構造(a) 構造の模式図,(b) Γ点のSPP定在波の強度分布,(c)D/P = 2/5 試料からのARSパターンとピークエネルギーのフォトン マップ,(d)D/Pに対するバンド構造変化,(e)Γ点のバンド 端エネルギーのD/P依存性,(f)円形状穴の配列をもつ試料に おけるバンド端エネルギーのD/P依存性.

D = 240 nm の試料からの ARS パターンと, Γ点の放射を用 いて測定したバンド端エネルギーのフォトンマップを示す. ピークエネルギーは 1.76 eV, 1.93 eV および 2.05 eV で, 図 9 (b) と比較することで低エネルギー側から A, E, B モー ドの順に並んでいることが分かる. D/P を変えるとバンドは 図 9 (d) のように変化することが測定された. 図 9 (e) に, Γ 点でのバンド端エネルギーの D/P に対する変化をグラフに 示した. D/P が 1/2 付近で A モードと E モードのエネルギー が交差するのが見られる. 同様の測定を円形の穴の周期配列 構造について行った結果を図 9 (f) に示す. この構造では A モードが最も高いエネルギーをもつ. また, D/P が 0.6 付近 で E モードと B モードのエネルギーが交差する.

## 5.2 六方格子

六方格子配列した円柱が作る 2 次元プラズモニック結晶で は  $\Gamma$ 点の最低エネルギー位置に 6 個のバンドが交わる. 群 論から 2 重に縮退したモードが 2 つ ( $E_1 \ge E_2$  モード) 形成 されるため全部で4 つのエネルギー準位が現れる. 4 つの SPP 定在波の表面垂直電場の時間平均した強度分布を図 10 (a) に示す. 図 10 (b) に、円柱間の間隔 P を 600 nm、円柱 の直径 D を D/P = 1/3 とした構造からの表面垂直方向の放射 を用いて測定したフォトンマップをエネルギーの大きさの順 番に並べた. 図 10 (a) と (b) のパターンが対応することから  $\Gamma$ 点の SPP 定在波モードが決定される. パターンに差異が あるのは、実験では放射の偏光方向を選んで測定しているこ とと、円柱の近傍に励起された局在プラズモンによる放射が 加わっているためである.  $\Gamma$ 点付近のバンド構造は図 10 (c)



図 10 六方格子 2 次元プラズモニック結晶のバンド構造 (a) Γ 点の SPP 定在波の強度分布, (b) D/P = 1/3 試料からの放射 のピークエネルギーに対応するフォトンマップ, (c) D/P = 1/3 のバンド構造, (d) Γ 点のバンド端エネルギーの D/P 依存性.

のように決まる.また、D/Pを変えたときのバンド端エネル ギーの変化を図 10 (d) に示す.正方格子の場合と同じよう にAモードと $E_1$ モードのエネルギーの大きさがD/P = 0.6付近で入れ替わる.

## 6. プラズモニック Cavity

プラズモニック結晶に欠陥構造を導入すると局在状態が形成され、さらに強い電場増強効果が得られる. このような Cavity を 1 次元プラズモニック結晶内に作製し、その性質を 系統的に調べた<sup>18)</sup>(図 11 (a)). 周期 600 nm、テラス幅 150 nm、テラス高さ 100 nm のプラズモニック結晶で挟んだ Cavity からは  $\Gamma$  点のバンドギャップ内に Cavity モードによ る放射が現れるのが角度分解スペクトルパターンから観察される. Cavity の幅を大きくしていくと、図 11 (b) に見られ るように Cavity による放射パターンは表面垂直方向( $\theta = 0^{\circ}$ ) に集中したり、傾いた方向に分裂したりするのを繰り返す. これは図 11 (c) に示すように Cavity 内に異なる対称性の SPP 定在波が順次に形成されるからである.

欠陥の溝幅を増加していくと Cavity モードのエネルギー は下がっていく. Cavity 幅 L として欠陥の両側のテラスの 中心間の距離をとり, L に対して Cavity モードのエネルギー をプロットした結果を図 11 (d) に示す. Cavity 内に定在波 が形成される条件は

$$k_n L + \Phi = n\pi \tag{13}$$

と書ける. ここで、Φは Cavity の端で SPP が反射されると きの位相シフトを表し、整数 n はモードの次数を表す. バン ド端のエネルギーで Cavity モードの定在波はプラズモニッ ク結晶中の定在波と連続的に繋がると考えると、今回用いた



図 11 1次元プラズモニック結晶内の Cavity (a) 模式図, (b) ARS パターン (L=450, 800, 1200, 1500 nm), (c) n次の Cavity モード定在波, (d) Cavity モードエネルギー vs. Cavity 幅, (e) SPP 反射の位相シフト vs. Cavity エネルギー.

D/P = 1/4 のプラズモニック結晶では高い方のバンド端エネ ルギー( $E^{+}$ )で反対称モードになるから $\Phi = \pi$ であり,低い 方のバンド端エネルギー( $E^{-}$ )では対称モードになるから  $\Phi = 0$ になると予想される. Lがプラズモニック結晶の半周 期の整数倍になるごとに高い方のバンド端エネルギー位置に プラズモニック結晶中の反対称モードとつながる Cavity モー ドが現れる. nが偶数の場合は対称モードとなり,奇数の場 合は反対称モードとなる(図 11 (c)).

(13) 式に現れる SPP の波数  $k_p$  は, Cavity 幅を変えモード のエネルギーが変化するときどうなるかを見るため, Г点の 放射の BSS 像から定在波の波長を測定したところ, 平面上を 伝播する SPP の分散関係((1)式) に従って変化することを 見出した<sup>17)</sup>. そこで,各モードに対して(13) 式から位相シフ トを計算しエネルギーに対してプロットした結果を図 11 (e) に示す. バンドギャップ内を 0 から  $\pi$  までエネルギーに比例 して変化する直線(図中の実線)に沿って  $\Phi$  が変化している が,ギャップの中心付近ではその傾きが小さくなる傾向がみ られる. ギャップの中心に Cavity モードのエネルギーを設 定したい場合には, $\Phi = \pi/2$  として(13) 式から L を決めれ ばよい.

# 6. まとめと今後の展望

プラズモニクスの最近の技術的進展は著しい.一方で、プ ラズモニック結晶のバンド構造などの基本的性質は十分に明 らかにされないままに応用を進めている観もある. 今回, 矩 形断面をもつ周期構造のプラズモニック結晶とその内部の欠 陥(Cavity)の性質を STEM-CL 法により調べた結果を中心 に紹介した. この手法は SPP の分散関係を明らかにしなが ら特定の SPP モードの性質を高い空間分解能で調べること ができる.また、電子ビームが試料上の任意の位置に点光源 として SPP を励起でき、全てのエネルギーの SPP モードの 振る舞いを一挙に調べることができる特徴をもつ. 最近では Cavity については1次元の場合でも欠陥部分を溝の代わりに テラスにするとモードの対称性が変わること、D/Pの異なる プラズモニック結晶で挟むとモードのQ値が変化すること なども分かってきた.2次元プラズモニック結晶中の Cavity や層状の構造を取り入れた場合の Cavity など、さまざまな バリエーションが考えられる. その他にも, 微粒子や微粒子 系の局在表面プラズモンによる表面増強ラマン散乱のような 現象や光学領域のナノアンテナの特性を評価することなどに

も適用できる.また,これまで CL 法が扱ってきた半導体ナノ構造をもつ発光物質との相互作用なども LED 増強効果と 関連して興味深いテーマである.STEM-CL 法はプラズモ ニック材料の性質とその機能を詳細に調べる上で光学測定な ど他の手法では得るのが困難な情報を容易に得ることができ る.応用研究への適用を含め今後の展開に期待したい.

# 謝 辞

本研究は東工大大学院の研究室に所属した多くの学生によ る成果をまとめたものである. プラズモニック構造の製作に は文科省委託事業ナノテクノロジー・プラットフォームの支 援を受けた. これらの方々に, ここで感謝致します.

#### 文 献

- 1) Ritchie, R.H.: Phys. Rev., 106, 874 (1957)
- Raether, H.: Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings, Springer-Verlag (1988)
- Ebbesen, T.W., Lecec, H.J., Chaemi, H.F., Thio, T. and Wolf, P.A.: *Nature*, 391, 667–669 (1998)
- 4) Homola, J.: Chem. Rev., 108, 462–493 (2008)
- Maier, S.A.: Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer (2007)
- Brongersma, M.L. and Kik, P.G. (eds.): Surface Plasmon Nanophotonics, Springer Series in Optical Sciences (2007)
- 7) 岡本隆之,梶川浩太郎:プラズモニクス-基礎と応用,講談社 (2010)
- 8) 梶川浩太郎, 岡本隆之, 高原淳一, 岡本晃一: アクティブ・プ ラズモニクス, コロナ社 (2013)
- 9) Heitmann, D.: J. Phys. C., 10, 397 (1977)
- 10) 鈴木崇之, 山本直紀:日本結晶学会誌, 50, 282-287 (2008)
- 11) 山本直紀, 鈴木喬博, 竹内健悟: 顕微鏡, 44, 268-274 (2009)
- 12) Suzuki, T. and Yamamoto, N.: Opt. Express, 17, 23664-23671 (2009)
- Yamamoto, N.: The Transmission Electron Microscope, InTech, Ch.15, 1–24 (2012)
- 14) Barnes, W.L., Preist, T.W., Kitson, S.C. and Sambles, J.R.: *Phys. Rev. B*, 54, 6227–6244 (1996)
- 15) García de Abajo, F.J. and Kociak, M.: Phy. Rev. Lett., 100, 106804 (2008)
- 16) Watanabe, H., Honda, M. and Yamamoto, N.: Opt. Express, 22, 5155–5165 (2014)
- Takeuchi, K. and Yamamoto, N.: Opt. Express, 19, 12365–12374 (2011)
- 18) Honda, M. and Yamamoto, N.: Opt. Express, 21, 11973-11983 (2013)